

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 8 月 3 日 (2006.8.3)

【公開番号】特開 2005-321746 (P2005-321746A)

【公開日】平成 17 年 11 月 17 日 (2005.11.17)

【年通号数】公開・登録公報 2005-045

【出願番号】特願 2004-210902 (P2004-210902)

【国際特許分類】

**G 0 9 F 9/00 (2006.01)**

**B 3 2 B 7/02 (2006.01)**

**B 3 2 B 9/00 (2006.01)**

**H 0 1 J 11/02 (2006.01)**

**H 0 5 K 9/00 (2006.01)**

【F I】

G 0 9 F 9/00 3 1 3

G 0 9 F 9/00 3 0 9 A

B 3 2 B 7/02 1 0 4

B 3 2 B 9/00 A

H 0 1 J 11/02 E

H 0 5 K 9/00 V

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 6 月 16 日 (2006.6.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 7 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 7 0】

(分析方法)

本発明における積層体の分析手法は以下の通りである。

積層体表面の原子組成は、オージェ電子分光法 (AES)、蛍光 X 線法 (XRF)、X 線マイクロアナライシス法 (XMA)、ラザフォード後方散乱分析法 (RBS)、X 線光電子分光法 (XPS)、真空紫外光電子分光法 (UPS)、赤外吸収分光法 (IR)、ラマン分光法、2 次イオン質量分析法 (SIMS)、低エネルギーイオン散乱分光法 (ISS) 等により測定できる。また、積層体中の原子組成及び膜厚は、X 線光電子分光法 (XPS) やオージェ電子分光法 (AES) や 2 次イオン質量分析 (SIMS) を深さ方向に実施することによって調べることができる。

積層体の構成及び各層の状態は断面の光学顕微鏡測定、走査型電子顕微鏡 (SEM) 測定、透過型電子顕微鏡測定 (TEM) を用いて調べることができる。